

話 題

新技術開発センター開所のお知らせ

FUJICO の技術開発を担う新たな技術開発センターが、環境先進都市・北九州市のシンボリックな場所である若松区の響灘地区に 2019 年 4 月に竣工、北九州市戸畑区牧山からこの 6 月に全面移転しました。

新たな技術開発センターは、光触媒製品の生産を担う若松響工場に隣接し、(株)豊川設計事務所の設計、工事管理のもと、「感性を磨ける空間設計」を理念に中庭を盛り込むなど、新技術開発の拠点として意見交換しやすく、リラックスして発想やアイデアを豊かにするように意図して建設されました。

その外観はスタイリッシュで、工場が立ち並ぶ周囲の景観の中でひととき存在感が光る建物です。



写真1 全景

技術開発センターの研究棟 1 階には、弊社の歴史、技術開発の推移及び解説、再生・摩擦圧接の新技術を適用した熱間圧延用ワークロール等の製品サンプルを展示した FUJICO INNOVATION GALLERY を開設しました。

また、研究棟 2 階には、技術開発センター、若松響工場、エンジニアリング事業部及び(株)アソートフジの事務所、ミーティングルーム、応接室を設けています。



写真2 技術開発センター 研究棟



写真3 FUJICO INNOVATION GALLERY

中庭には、ゆったりとした空間にキッチン、ワインセラーも備えたおもてなしスペースとして F.Fonte (エフ・フォンテ) を開所しました。

Fは「フジコー」を、フォンテは「泉・源」を意味しており、ここではお客様とフジコーの社員とがともに語らい、泉のように新しいアイデアやプランが生まれることを期待して、命名しました。



写真4 F.Fonte

作業棟には、多方面にわたる技術開発を可能にするため、「世界でここだけしかない」施設・設備、及び最先端の機器・装置を設置しています。これらの設備・装置により、多目的な試験・設計・試作・開発が可能になりました。

作業棟の 1 階には、直径 700mm の大径鋼材の摩擦圧接機、温度可変型溶射装置などの機械設置スペース、高性能 SiC セラミックス材を開発する高温高真空焼成炉ブースと加工ブース、最新の円筒型太陽電池開発用の発電層成膜用前処理室と試作室、及び溶射技術を適用した熱電変換効率に優れ高温環境下でも使用できる新型熱電変換モジュールの試作室を設けています。



写真5 機械設置スペース

作業棟の2階には、顧客ニーズに応える新規組成金属材料の組織ミクロ観察や硬度測定などを行う試験室、光触媒に関連し、光触媒材料の合成・開発などを行う評価試験室、ガス成分の定量分析を行う GC 分析室、抗菌性や浮遊菌の除菌性を測定する菌試験室、及び活性炭酸化作用による難分解性成分の分解性能や光触媒で処理した水の有害成分の分解・除菌性能を評価する水処理試験室、及び脱臭・除菌装置や作業用ロボットスーツなどの幅広い新製品の開発を担うメカトロニクス作業室を設けています。



写真6 SiC 加工ブース



写真9 金属材料の試験室



写真7 太陽電池試作室



写真10 光触媒の評価試験室



写真8 熱電変換モジュール試作室

新たな技術開発センターの概要を下記します。

敷地面積 7,279 m²

研究棟床面積 1,892 m²

作業棟床面積 2,011 m²

33年後に迎える FUJICO 創業 100 周年に向けて、今後は現在の開発の延長線上にはない新しい開発テーマへもチャレンジし、引き続き皆様のご期待・ご要望に応える所存です。

問い合わせ先
 技術開発センター 開発管理室
 担当：知財・法務係 福田 隆三
 TEL 093-701-4500
 FAX 093-701-4501